

UVインプリント装置

Nano Imprint-Lithography

3タイプのインプリント方式をラインナップ

低残膜ステッパー方式装置

ImpFlex Essential

アライメント機能を搭載したリソグラフィー低残膜転写



高精度アライメント機能付き転写装置

OPIC8

高粘度UVレジスト塗布機能搭載

8インチ全面一括転写



大面積平板ロール式転写装置

フィルムレプリカモールド作成

最大G5.5の大面積対応

